DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 01309464

THIN FILM TRANSISTOR

PUB. NO.: **59-021064** [JP 59021064 A]

PUBLISHED: February 02, 1984 (19840202)

INVENTOR(s): OSHIMA HIROYUKI

KODAIRA TOSHIMOTO

MANO TOSHIHIKO

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)

, JP (Japan)

57-074014 [JP 8274014] APPL. NO.:

FILED: April 30, 1982 (19820430)

INTL CLASS: [3] H01L-029/78; H01L-027/12

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 244, Vol. 08, No. 103, Pg. 134, May

15, 1984 (19840515)

ABSTRACT

PURPOSE: To enable to largely reduce photocurrent by a method wherein the channel region on a thin film transistor is coated by extending a source electrode or a drain electrode.

CONSTITUTION: The channel region of the transistor is coated with the extended source electrode, therefore no light is incident to the channel region. It is desirable that a gap 17 is as narrow as possible for the light incidence from the gap between the above-mentioned source electrode and the drain electrode. The width of the gap is determined by the limitation of patterning technique. On the other hand, the light incident from the gap 17 is mainly contributed to the carrier production in the drain region 11, therefore hardly participated in the generation of photocurrent. It is because normally the impurity density of the drain

region 11 is very high and the lifetime and mobility of carriers generated are small.

?

① 日本国特許庁 (JP)

訂正有り

⑩公開特許公報(A)

昭59—21064

⑤Int. Cl.³
 H 01 L 29/78
 // H 01 L 27/12

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 8122-5F 砂公開 昭和59年(1984)2月2日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

❷薄膜トランジスタ

②特 願 昭57-74014

②出 願昭57(1982)4月30日

⑫発 明 者 大島弘之

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舍内

⑫発 明 者 小平寿源

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

仍発 明 者 真野敏彦

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舍内

切出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

砂代 理 人 弁理士 最上務

明 組 鲁

発明の名称

脊膜トランジスタ

特許請求の範囲

(1) 半導体薄膜を用い、ソース電極とドレイン電極とゲート電極を備えた薄膜トランジスタにおいて、前記ソース電極あるいは前記ドレイン電極のうち一方を延長することにより、前記薄膜トランジスタのチャネル領域を被覆したことを特徴とする薄膜トランジスタ。

発明の静細な説明

本発明は光電流を低減させる構造を有する半導 ・ 体薄膜トランジスタに関する。

近年、絶象基板上に静膜トランジスクを形成する研究が活発に行なわれている。この技術は、安 価な絶縁基板を用いて薄形ディスプレイを実現するアクティブマトリックスパネル、あるいは通常 程度トランジスタをアクティブマトリックスポ ネルに応用した場合の液晶表示装置は、一般に、 上側のガラス基板と、下側の薄膜トランジスタ基板上にマトリック おり、前配薄膜トランジスタ基板上にマトリック ス状に配置された液晶駆動案子を外部選択回路に より選択し、前配液晶駆動案子に接続された液晶 駆動電極に電圧を印加することにより、任意の文 字,図形、あるいは画像の表示を行なうものであ

(1

--297--

(2)

特園昭59-21064 (2)

る。前記薄膜トランジスタ基板の一般的な回路図 を館1図に示す。

第1図(a)は脊膜トランジスタ基板上の液晶 斟酌累子のマトリックス状配置図である。 図中の 1 で囲まれた餌域が投示領域であり、その中に被 **晶彫動業子2がマトリックス状に配置されている** 。 3 は液晶配動素子 2 へのデータ 信号ラインであ り、4は液晶配動業子2へのタイミング信号ライ ンである。液晶彫動紫子2の回路図を第1図(♪)に示す。5は弾膜トランジスタであり、データ のスイッチングを行なう。6はコンデンサであり 、データ餌号の保持用として用いられる。このコ ンデンサの容量としては、液晶自体の有する容量 と放意に設けたコンデンサの容量を含むが、場合 によっては液晶の容量のみで構成されることもあ る。7は液晶パネルであり、7~1は各液晶配動 業子に対応して形成された液晶駆動電極であり、 7一2は上側ガラスパネルである。

第2図は半導体薄膜を用いた従来のヨチャネル 薄膜トランジスタの一般的な構造を示す断面図で
(a)

により決定されるため、短時間にデータを完璧に 者き込むことができるように、移政トランジなら は充分大きい電流を流すことができ流という。 ない。この時の電流(以下、の当電流という。 は、コンデンサの容量と、書き込み時間とが まり、そのの当電流をクリアできるように 様という。 まり、そのの当電流をクリアできるい。 様というの は、コンジスタの流すことができるの当電流は、トラン ンジスタの流すことができるの当電流は、トラン ジスタのサイズ(チャネル長とチャネル幅)、 遊、製造プロセス、ゲート電圧、ドレイン電圧 とに大きく依存する。

(3)は、コンデンサに書き込まれたデータの保持特性に関するものである。一般に、書き込み時間よりもはるかに長い時間、 着されなくてはならない。コンデンサの容量は、 道常 1 P P 程度の小さい値であるため、 薄膜 トラ 窓路 1 P P 程度の小さい値であるため、 薄膜 トラ 窓路 (以下、 0 P P 電流という。)が流れると、ドレインの電位(すなわち、コンデンサの電位)は急能にソースの電位に近づき、書き込まれたデータ

ある。8はガラス・石英などの絶縁性透明基板、 9は多結晶シリコンなどの半導体薄膜、10は半 湖体薄膜中にリンやと繋などの不純物をドープし で形成したソース領域、11は同じくドレイン領域、12はゲート膜、13はゲート電極、14は 層面絶縁膜、15はソース電極、16はドレイン 電板である。

このような薄膜トランジスタをアクティブマトリックスパネルに応用する場合、薄膜トランジスタは、液晶に印加する電圧のデータをスイッチングするために用いられ、このとき薄膜トランジスタに要求される特性は大きく次の2種類に分類される。

- (1) 薄膜トランジスタを O B 状態にした時コン デンサを充電させるために充分な電流を流す ことができこと。
- (2) 薄膜トランジスタを O ア ア 状 照にした 時、 低力、電流が流れないこと。
- (1) は、コンデンサへのデータの書き込み特性に関するものである。液晶の表示はコンデンサの電位 (4)

は正しく保持されなくなってしまう。したがって 、OPP電流はできる限り、小さくしなくてはな らない。

第3 図は、第2 図に示した構造を有する薄膜トランジスタの特性を示すグラフである。 なお、このデータは本出図人が実験を行なって得られた結果である。このグラフの機動はソースに対するゲ

(5)

--298--

(0)

特別昭59-21064 (3)

ート電圧 V a a であり、被軸はドレイン電流 I b a である。ソースに対するドレイン電圧 V b m は 4 V である。

図中、Aの実験のグラフは光を照射しない時のドレイン電流(暗電流)を示し、Bの破線のグラフは1万ルックスの光を照射した時のドレイン電流を示している。第3図からわかるように、光を照射することによりON電流はほとんど増加しないが、OPP電流は大幅に増加している。このため、ON/OPP比がとれなくなり、したがって十分なトランジスタ特性が得られない。

本独明は、このような従来の薄膜トランシスタの欠点を除去するものであり、その目的とするところは、光電流を低減させる構造を有する薄膜トランシスタを提供することである。これを実現するために本発明では、半導体薄膜を用い、ソース性低とドレイン関係とゲート関係を働えた砂膜トランシスタにおいて、前配ソース電極あるいは前記ドレイン関極を延長することにより、前配薄膜トランシスタのチャネル領域を被殺したことを特

延長することによりチャネル部を被覆する場合に ついて示したが、ドレイン電極を延長することに よりチャネル部を被覆してもよい。この場合にも 、上述した説明は同様に成立する。

また本発明では、ソース領域10あるいはドレインのうちったは、チャネル射するの数はに、 一次の対するのがないないが、 かいないが、 ないないのが、 ないのが、 ないのが、 ないのが、 ないのが、 ないのが、 ないのが、 ないのが、 ないののではない。

第5図は、第4図に示した構造を有する種膜トランジスタの特性を示すグラフである。このデータも本出顔が実験を行ない得られた結果である。 酸々のパラメータは第3図の場合と同様である。 図中、0の実験のグラフは光を照射しない時のド 徴とする薄膜トランジスタを提供する。以下、図 を参照しつつ、本発明を贈しく説明する。

第4図は本発明による薄膜トランジスタの構造 を示す断面図である。図中B~16の意味する内 容は、第2図と全く同様である。第4図からわか るように、トランジスクのチャネル領域は延長さ れたソース包括により被覆されている。したがっ てチャネル領域には全く光が入射しない。ただし ソース電極とドレイン電極の間隙17からは光が 入射するための、この間疏はできる臥り狭いほう が留ましい。その間隙の幅はベターニング技術の 限界により決定される。 しかし、 間隙 1 7 から入 射する光は、主にドレイン領域11におけるキャ リア生成に寄与するため、光電流の発生にはほと んど関与しない。これは、通常、ドレイン領域 11の不純物濃度が非常に高く、発生したキャリ アのライフォイム及び移動度が小さいためである 。したがって餌4図に示すような存造を採用する ことにより、光電流の発生を充分小さく抑制する ことができる。なお、第4図では、ソース電極を

レイン電流(暗電流)を示し、Dの破糠のグラフは1万ルックスの光を照射した時のドレイのグラフは、第3図のAのグラフは、第3図のAのグラフは、第3図のAのグラフは、第3図のAのグラフは、第3図のAのグラフは、第3図のがあり、1万ルックをであり、1万ルックをであり、1万ルックがであり、1万ルックがであり、1万ルックがであり、1万ルックがであり、1万ルックがであり、1万ルックがである。なりである。なりができる。なりができる。なりができる。なりができる。なりができる。なりができる。なりができる。なりができる。なりができる。なりができる。なりができる。なりができる。なりないできる。なりができる。なりができる。なりができる。なりないできないできる。なりができる。なりないできる。なりないできる。なりないできる。なりないできる。ないでは、1万ルでは、1万のでは

(8)

以上、述べたように、本発明は光電流を大假に 低減せしめるという優れた効果を有する静膜トランジスタを提供するものである。

図面の簡単な説明

第1図(a)(b)は薄膜トラングスタをアクティブマトリックスペネルに応用した場合の一般的な国路図である。

(44)

特開昭59-21064 (4)

第2図は半導体薄膜を用いた B チャネル薄膜トランジスタの一般的な構造を示す断面図である。 第3図は従来の薄膜トランジスタの特性を示す グラフである。

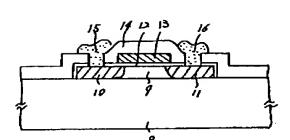
第4図は、本発明による薄膜トランジスタの構 造を示す斯阗図である。

第 5 図は、本籍明による薄膜トランジスタの特性を示すクラフである。

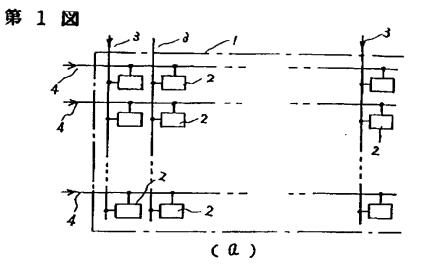
上 以

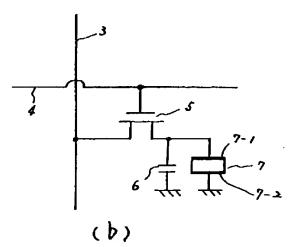
出題人 株式会社郞訪蒂工會 代理人 弁理士 最上 務

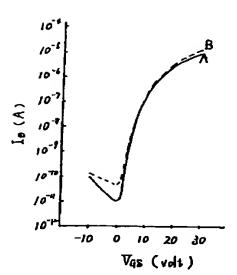
0.0



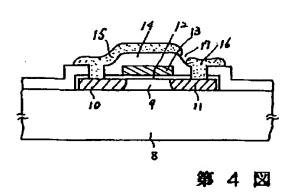
第 2 図



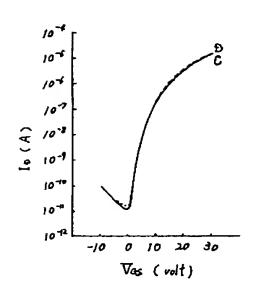




第 3 図



特圖昭59-21064(5)



第 5 図

(4)

26.3

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 57 年特許願第 74014 号(特開昭 2月2日 59-21064 号, 昭和 59 年 号掲載) につ 発行 公開特許公報 59-211 いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 7 (2)

Int. C1.			識別記号	庁内整理番号
//	H 0 1 L H 0 1 L	29/78 27/12		8 4 2 2 - 5 F 7 5 1 4 - 5 F

手統補正書

- 1. 発明の名称を以下の如く補正する。
- 「液晶表示装置」
- 2. 特許請求の範囲を別紙の如く補正する。
- 3. 明細書中、第10頁第15行目「ある。」を 以下の如く補正する。

「ある。

上述の如く本発明は、一対の基板内に被晶が 封入され、該基板の一方の基板上に設けられた 西素電極、該画素電極に接続され、該基板上に 設けられてなる薄膜トランジスタ、 該薄膜トラ ンジスタのゲート電極に接続されてなる走査信 号線、該薄膜トランジスタのソース電極に接続 されてなるデータ信号線を有する液晶表示装置 において、該薄膜トランジスタのチャンネル領 域は、該ソース電極配線を延長した延長配線に より被覆されてなるようにしたから、液晶パネ ルに入射した光によって薄膜トランジスタの摂 を得ることができる。」

手続補正審 (自発)



平成元年4月24日

特許庁長官 吉田 文毅 殿

- 1. 事件の表示
 - 昭和 57
- 2. 発明の名称
- 液風吸示滤電
- 3. 補正する者

事件との関係 出願人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (236) セイコーエブソン株式会社 代表取締役 中村恒也

4. 代 選 人

〒 163 東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号 セイコーエブソン株式会社内 .

弁理士 (9338) 鈴木 喜三郎 (他1名 電話 03-348-8531 内線 300~302



5. 補正により増加する発明の数

0

6. 補正の対象 明和書(発明の名称、特許請求の範囲、発明の詳細な説明)

7. 補正の内容

別紙の通り

昭和60年11月14日名称及び住所変更済(一 用船盘三门

特許請求の範囲

一対の基板内に液晶が封入され、該基板の一方 の基板上に設けられた画業電極、該画業電極に接 統され、政基板上に設けられてなる薄膜トランジ スタ、該薄膜トランジスタのゲート電極に接続さ れてなる走査信号線、該薄膜トランジスタのソー ス電極に接続されてなるデータ信号線を有する液 <u> 晶表示装置において、該薄膜トランジスタのチャ</u> ンネル領域は、核ソース電価配線を延長した延長 <u>配線により被覆されてなること</u>を特徴とする<u>液晶</u> 表示装置。